

粗粒子珪素 成形體의 效果的 窒化加熱法에 관한 研究 (Densification of Silicon Nitride 3 報)

朴 金 詰·崔 相 旭*

漢陽 大學校
(1984年 2月 3日 接受)

Effective Nitridation of Compacts of Coarse Silicon Particles

Keum-Churl Park and Sang-Wook Choi*

Hanyang University
(Received Feb. 3, 1984)

ABSTRACT

To find out the optimum heating profile for the nitridation of compacts of graded silicon grains (max. 53 μm), two batches with the addition of MgO and $\text{Mg}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ to silicon particles were isostatically pressed into compacts. They were nitrided under some different nitriding schedules.

The properties such as bulk densities, microstructures and formed phases were measured and observed. The following results were obtained:

- 1) About 10% unreacted silicon remained in specimen which was nitrided at 1,350°C for 240hrs.
- 2) One of the step-heating processes, 1,150°C-1,390°C for 65hrs and then 1,390°C for 50hrs, was the most effective in the nitridation. The nitridation was not greatly increased with the holding time at low temperature, but with that at high temperature.
- 3) High pressure (10.5kgf/cm²) of nitrogen at 1,390°C accelerated the $\alpha \rightarrow \beta$ transformation of silicon nitride.
- 4) Magnesium nitrate was superior to magnesium oxide in the role of nitriding aid and the formation of uniform microstructures.

I 緒論

金屬狀의 硅素을 1,200~1,400°C의 窒素雰圍氣에 尾면 窒化反應을 일으켜서 窒化硅素(Si_3N_4)가 되는 것으로 알려져 있다^{1~3)}. 이러한 窒化反應에 미치는 因子는 (1) 硅素粒子의 特性^{4~10)} (2) 硅素의 處理方法^{5~7, 17~20)} (3) 窒化反應의 條件^{2, 6, 17, 20~27)} 等을 들 수 있는데 硅素粒子의 特性으로는 粒子의 크기(比表面積) 및 分布^{4, 5, 15, 16)}, 不純物의 種類 및 含量^{6~14)} 等이고, 硅素의 處理方法으로서는 硅素의 磨碎(attrition)^{17, 18)}, 窒化反應助劑의 種類 및 添加方法^{5~7, 19)}, 成形方法 및 成形壓^{2,}

5, 28)

不活性ガス중에서 硅素成形體의 前燒結²⁰⁾ 等이니 窒化反應의 條件으로는 窒化ガス의 種類^{12, 17, 20, 25, 29, 30)}, 窒化ガ스의 壓力^{27, 31)}, 가스의 流通速度³²⁾, 窒化溫度 및 維持時間等이 포함된다. 이들 중에 窒化反應의 條件의 한 部分인 窒化反點에 쓰이는 窒化ガス에 水素가 少量 섞여 있으면 高溫에서 硅素 및 窒素와 각각 反應하여 SiH_4 와 NH_3 로 되고 이들이 서로 氣相反應하여 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 가生成되는데 이것은 矢고 均一한 結晶과 気孔을 갖는 紡織을 갖게 된다²⁰⁾. 또한 水素ガス는 窒化物層에 生成된 6 方形管(hexagonal tunnel)을 막히지 않게 해 주므로 窒素의 供給이 계속되어 窒化率이 높아진다²⁵⁾. 또 窒素ガス에 水素³⁾와 水蒸氣¹³⁾가 少量 포함되어 있으면 雰圍氣內 酸素의 分離를 阻止할 뿐 아

* 仁荷大學校
Inha University

나라珪素粒子表面의 실리카(SiO_2)층을 SiO 로變化.揮發시켜서窒化反應이促進된다고알려져있다.珪素가스에암모니아가스가存在하면珪素(液相)의表面에서分解되어原子狀의珪素가되는데그擴散速度는固相에서보다液相에서더빠르기때문에液相에서는 β -相의 Si_3N_4 의生成이支配的이다³³⁾. Mangels³⁴⁾는珪素에 H_2 , He , Ar 等을混合하여窒化反應시킨結果는96% N_2 -4% H_2 및46% N_2 -4% H_2 -50% He 을사용하여만든窒化珪素體의機械的強度가가장좋았고($2,815 \pm 408 \text{ kgf/cm}^2$, $3,182 \pm 377 \text{ kgf/cm}^2$),이들의窒化速度는 $15.3 \pm 2 \text{ gSi/hr}$ 및 $34.6 \pm 6 \text{ gSi/hr}$ 이다.

한편珪素의分壓을減壓 또는 Ar 과珪素와의混合으로 1.0 atm 이하로낮추어주므로써窒化率 및物性을向上시켰다^{31,35)}. 또한窒化가스의흐름速度가빠들경우에는static상태에서보다窒化物의結晶이크고機械的強度가낮은데비하여가스의흐름速度가아주느리면 $1\mu\text{m}$ 이하의크기인 α -matte를만든다³⁶⁾. 또窒化率에크게영향을주는窒化反應의條件은窒化溫度 및維持時間이라할수있다. Messier³⁷⁾는段階窒化加熱法으로 $1,150 \sim 1,385^\circ\text{C}$ 의범위에서110時間동안窒化反應을시켰으며Herbell^{17,18,38)}은상온~ $1,380^\circ\text{C}$ 의범위에서維持및昇溫으로110時間동안,또상온~ $1,400^\circ\text{C}$ 의범위에서昇溫및維持의連續加熱法으로127時間동안각자窒化反應을시켰고Mangels³⁹⁾는상온~ $1,400^\circ\text{C}$ 의범위에서130時間동안段階窒化加熱과상온~ $1,380^\circ\text{C}$ 의범위에서160時間동안連續加熱法으로각자窒化反應을시켰다. 이러한窒化反應의加熱方法을Fig. 1에나타내었다. 그러나이런加熱方法은珪素의成形方法,處理方法,窒化가스의組成等의條件를다르게하여著者에따라어느한加熱method을비하여窒化反應을시켰고이에따른窒化率 또는機械強度를나타낸報告이기때문에가장적당한加熱method을比較,論議할수없다.

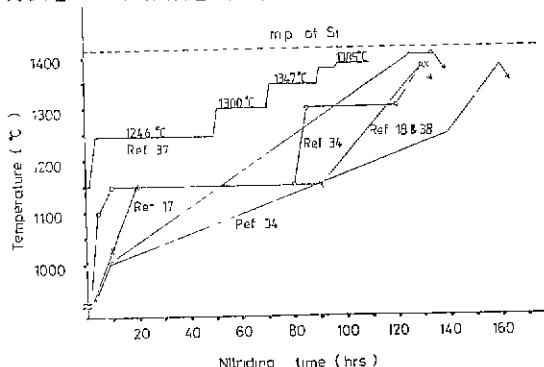


Fig. 1 Nitridding profiles reported.

本研究에서는窒化反應에영향을미치는여러因子들을一定하게固定시키고粗粒($53\mu\text{m} \sim 40\mu\text{m}$)으로高充填性珪素成形體를만들어여러加熱處理方法으로窒化反應을시킨다음,얻어진窒化珪素試片의窒化率 및微構造等을서로比較하여적당한窒化加熱條件을究明하고자한다.

II 實驗方法

1. 原料 및 試片調製

1報³⁰에서사용한珪素原料와試片調製方法에따라濕式isostatic press로 $4,224 \text{ kgf/cm}^2$ 의壓力下에서成形體(A), (B) 및(C)를만들었는데(A)는粒度調節한珪素($40 \sim 53\mu\text{m}$ Si : 50%, $10 \sim 40\mu\text{m}$ Si : 20%, $<10\mu\text{m}$ Si : 30%), (B)는(A)에 MgO 를添加한것, (C)는(A)에 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 를添加하여熱分解시킨것으로하였다.

2. 窒化反應

窒化反應에사용한窒化反應爐,反應容器,成形體를덮는가루,窒化가스의組成($95\% \text{ N}_2 + 5\% \text{ H}_2$)및가스흐름의速度(20ml/min)등은2報³¹의條件과같이하였으나다만窒化反應에대한水蒸氣의영향을들여주기위하여水蒸氣의含量을 10ppm 이하되도록調節하였다.窒化反應에쓰인加熱方法은Fig. 2에나타낸바와같이 $1,350^\circ\text{C}$ 에서 $30 \sim 240$ 時間동안維持한6種의等溫處理法을정하여低溫과高溫에서維持時間에따른窒化率을서로比較하고窒素壓에대한영향등을알아보기위하여7種의段階昇溫處理等으로하였으며얻어진窒化物의試片에대하여窒化率및組織等을比較하였다.

3. 窒化物의 實驗

부피比重,微構造의觀察等은2報³¹에서行한方法으로하였고窒化物중 α -相의定量分析은Gazzara等⁴⁰의方法으로행하였다.

III 實驗結果 및 考察

Fig. 2에나타낸加熱方法으로窒化反應시킨試片들에대하여定量分析⁴⁰한結果를Table I에나타내었다. 이중에 1350°C 에서 30 時間 또는 60 時間의간격으로 240 時間까지維持한試片들의未反應의珪素와 α/β 相의比를Fig. 3에나타내았다. 일반적으로 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 를添加한것이 MgO 를添加한것보다窒化率(α -相+ β -相)과 α/β 比가높았고未反應의珪素는維持時間의長短에관계없이약 10% 인데 MgO 를添加한것은維持時間을길게(240 時間까지)하므로써

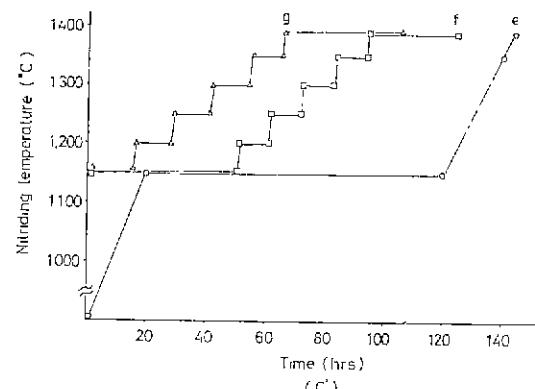
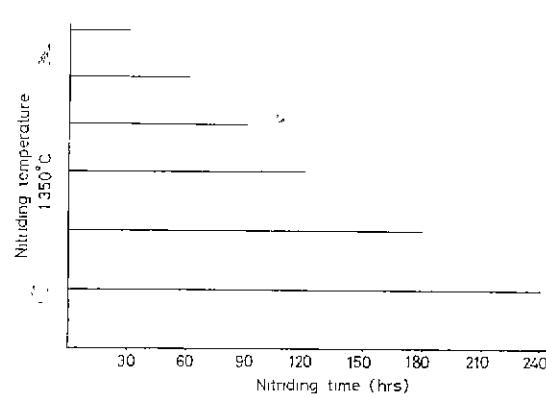
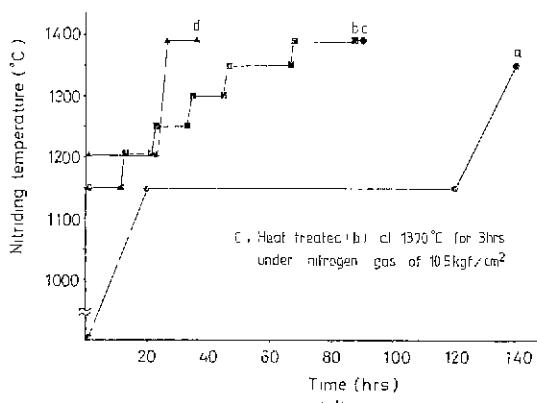


Fig. 2 Nitriding schedules of gap-graded silicon compacts, (A') (B') and (C')
(nitriding gas: 95% N₂-5% H₂, 10ppm water vapour, flowing rate: 20 ml/min.)



약 18%에서 10%로 줄일 수 있다. (C)를 30시간
維持한 것과 (B)를 240시간維持한 것의 未反應珪素

는 비슷한含量을 나타내고 있다. 한편, 10 μm 이하의
珪素粒子를 사용하고 成形壓 4,224 kg/cm²으로 成形
하여 1,350°C에서 30時間 유지한 試片³ (2報)에서는
거의 完全히 窒化反應이 終結되었다. 이러한事實로부터
窒化反應의 助劑로서는 Mg(NO₃)₂·6H₂O가 硅素
粒子表面에 均一한 分散性⁴ 때문에 더 效果의이었고
1報⁴에서 보면 比表面積⁵ 2827 m²/kg의 微粒子(<10
μm) 한일 때 보다 中間粒子와 粗粒子(<53 μm)를 混合
한 B'의 組成이 큰 摃密性⁶와 成形密度를 가지고 있다. 따
라서 反應에는 比表面積과 充填性에 의한 窒化gas와
의 接觸面積과 透過性이 큰 영향을 미치는 것으로 생각
된다. 且 未反應의 硅素가 오로 窒化反應에도 不拘하고
남아 있는 것은 生成된 窒化珪素層으로 因하여 粒子內

Table 1 Quantitative Analysis of Phases in Silicon Nitride Specimens, treated under the Nitriding Profiles of Fig. 2, by X-ray Diffraction.

(%)

Specimen	Phase	1,350°C					a	b	c	d	e	f	g
		30 h	60 h	90 h	120 h	180 h							
B	α	55.1	54.0	53.1	50.3	45.1	39.3	77.9	71.1	28.3	69.9	64.1	33.1
	β	27.0	29.9	32.8	36.4	43.0	50.4	8.6	9.2	58.3	13.7	24.7	61.4
	Si	17.9	16.1	14.1	13.3	11.9	10.3	13.5	19.7	13.4	16.4	11.2	5.5
	α/β ratio	2.04	1.81	1.61	1.38	1.05	0.78	9.06	7.73	0.49	5.10	2.60	0.54
C	α	59.1	58.7	57.0	56.2	50.8	43.5	79.3	77.5	31.6	78.6	61.4	57.1
	β	30.1	30.8	33.2	34.0	39.3	46.7	13.4	17.9	63.0	14.2	31.6	40.3
	Si	10.8	10.5	9.8	9.8	9.9	9.8	7.3	5.5	5.4	7.2	7.0	2.6
	α/β ratio	1.96	1.91	1.72	1.65	1.29	0.93	5.92	4.56	0.50	5.54	1.94	1.42

부의 硅素와 窒素의 接觸이 防害되어 反應이 抑制되기 때문에으로 생각된다. 즉 硅素는 固體擴散, 蒸發 및 溶解等의 機構로 窒化硅素의 核에 供給되고 氣孔을 남기게 되는데 이 氣孔의 入口(목) 부근은 窒化物로 탁하게 되므로 窒素의 供給이 되지 못한다는 自己密閉機構¹⁰⁾가 적용되는 경우로 보여진다. 또 Table 1에서 (a)~(g)의 加熱方法으로 만든 試片中 未反應의 硅素와 α/β 比를 Fig. 4에 나타내었다. 이들 중에 1150°C에서 長時間維持한 (a)와 (e)는 未反應의 硅素가 가장 많이 남아 있는 것에 속하는데 1,350°C까지 升溫시킨 (a)보다 1,390°C까지 升溫시킨 (e)쪽이 窒化率은 약간 良好한 편이나 α/β 比에 있어서는 (e)쪽이 낮은 것으로 보아서 $\alpha \rightarrow \beta$ 轉移에 高溫이 效果의 아파 할 수 있다. 이것은 β -相의 生成에 대한 液相存在說^{1,42)}이 뒷받침해 주고 있다. 즉 添加한 MgO는 硅素表面의 SiO₂와 또는 硅素중의 不純物과 反應하여 낮은 熔融點을 갖는 melt를 만드는 것으로 생각된다. 試片 (d)는 1,200°C에서 24時間維持한 것을 포함하여 모두 36時間維持하였으나 約 140時間維持한 (a)만큼 未反應의 硅素를 含有한 것은 低溫에서 오래 維持하더라도 窒化率에 큰 영향이 없고 오히려 高溫에서 維持시키는 것이 더 效果의 임을 나타내는 것으로 생각된다. 이러한 것은 (f)와 (g)에서도 볼 수 있는데 低溫에서 오래 維持한 (f)보다 高溫에서 오래 維持한 (g)는 未反應의 硅素가 거의 없음을 보여 준다. 또 試片 (B)는 1150°C에서 50°C 쪽 올려 12時間維持하였고 1,350°C와 1,390°C에서는 약 20時間維持한 것이며 試片 (C)는 試片 (b)를 다시 1,390°C와 10.5 kgf/cm²의 窒素壓下에서 3時間維持한 것인가 Mg(NO₃)₂·6H₂O를 添加한 試片 (c)에 있어서는 未反應의 硅素의 量은 (b)와 비슷하고, β -相의 含量이 많은 것으로 보아서 窒化反應은 더 進行되지 않았으나 $\alpha \rightarrow \beta$ 相轉移는 일어났음을 의미한다.

그러나 MgO를 添加한 試片 (B)에 있어서는 窒素壓下에서 窒化反應이 더 進行되었을 뿐 아니라 α/β 相의 比率도 상당히 낮은 것으로 나타났다.

1,350°C에서 加熱處理한 試片들에 대하여 處理前後의 質量變化를 Fig. 5에 나타내었다. Mg(NO₃)₂·6H₂O를 添加한 試片은 모든 維持時間(30~240時間)에서 MgO를 添加한 試片보다 質量의 增加가 커고 質量의 變化差(46~48%)는 全體의 維持時間에서 그다지 크지 않았다. 이것은 質量增加의 理論欲 53.15%에는 미치지 못하는 약 50% 이하인네 理論欲의 90.3%에 해당된다. 이러한 差異는 未反應의 硅素, MgO의 蒸發¹⁰⁾, 微量의

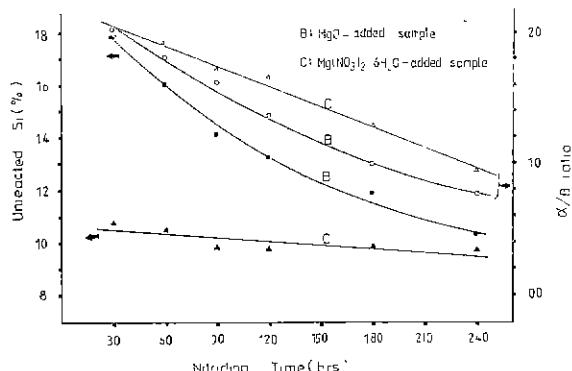


Fig. 3 Content of unreacted silicon and α/β ratio as a function of nitriding time at 1350°C.

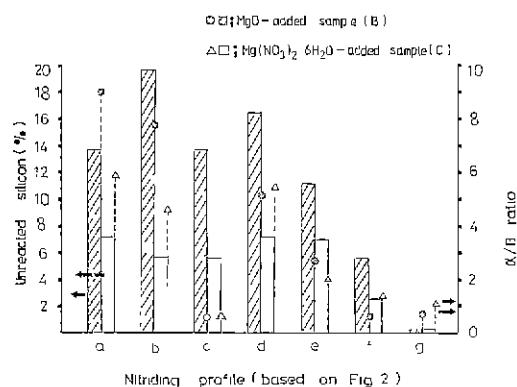


Fig. 4 Variation of unreacted silicon content and α/β ratio in silicon nitride sample

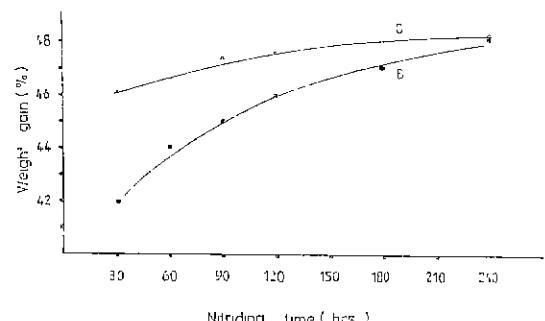


Fig. 5 Variation of weight gain in nitrided body with nitriding time.

酸素²⁷⁾, 水素²¹⁾ 및 水蒸氣²⁰⁾에 의한 硅素의 酸化와 SiO의 蒸發等에 起因하는 것으로 생각된다.

여기 試片들의 부피比重을 측정하여 Fig. 6과 7에 나타내었다. Fig. 6은 1,350°C에서 維持時間은 달리하여 만든 試片에 대한 것이고 Fig. 7은 段階加熱處理法으로

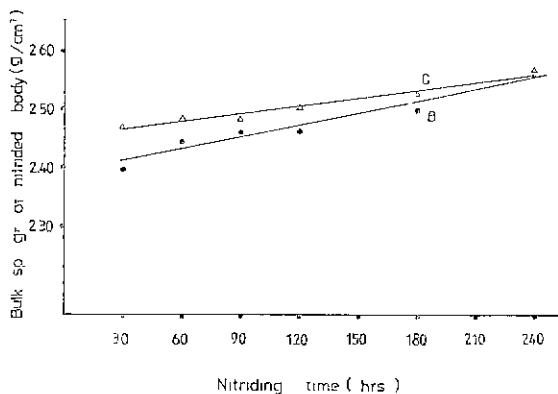


Fig. 6 Variation of bulk sp. gr. of nitrided body as a function of nitriding time.

일은 試片에 대한 것이다. Fig. 6 에서는 質量의 增加 曲線(Fig. 5)과 비슷한 傾向으로 부피比重값이 維持時間에 따라 增加하였는데 이것은 窒化率과 관계가 있음

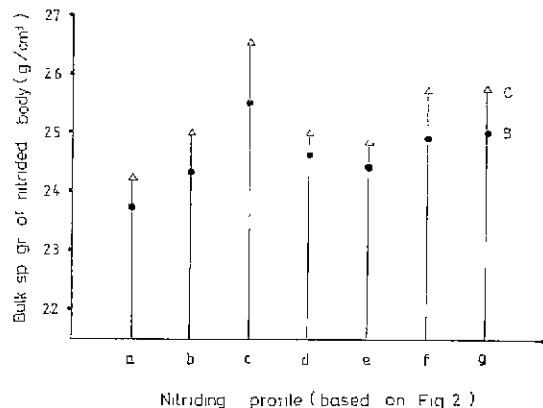


Fig. 7 Variation of bulk sp. gr. of nitrided body with respective nitriding profile.

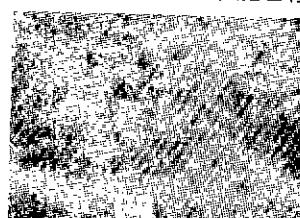
을 보여 준다. Fig 7 에서는 高壓으로 加熱處理한 試片



B(1350°C, 30hrs)

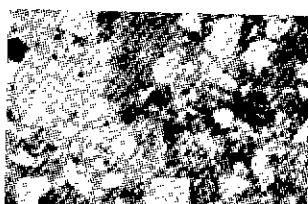


B(1350°C, 90hrs)

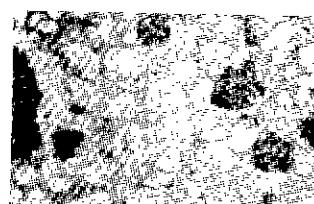


B(1350°C, 240hrs)

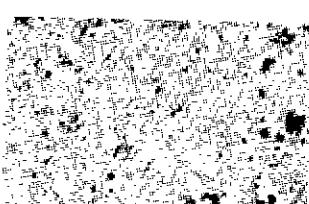
Fig. 8 Photographs of specimens (B), nitrided at 1350°C for 30hrs, 90hrs and 240hrs.



(A)



(B)



(C)

Fig. 9 Photographs of specimens (A), (B) and (C), nitrided on the heating profile of Fig. 2B' (b).

A; compact which consisted of 50% of 53-40 μ m Si, 29% of 10-30 μ m Si and 30% of <10 μ m Si and pressed isostatically at the pressure of 4224kgf/cm².

B; compact of 92% component (A) plus 8% MgO, made with the same applied pressure as compact (A).

C; compact of 92% component (A) plus Mg(NO₃)₂·6H₂O equivalent to 8% MgO, made with the same applied pressure as compact (A) after decomposition of the mixture at 300°C.

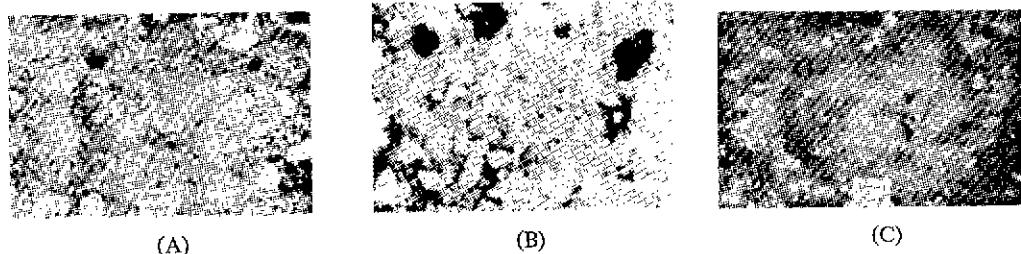


Fig. 10 Photographs of specimen (A), (B) and (C), nitrided on the heating profile of Fig. 2B' (c).

(C)가 가장 높은 부피比重을 가지고, 다음은 窒化率이 좋은 (g)와 (f)가 높았다. 試片 (C)가 높은 부피比重을 나타내는 것은 溫度이외에도 窒素壓이 收縮을 수반하는 燰結에 영향을 미친 것으로 생각된다. 1,350°C에서 窒化反應시킨 여러 試片중에서 30時間, 90時間, 240時間維持한 試片(B)에 대한 顯微鏡사진을 Fig. 8에 나타내었다. 흰색을 띤 硅素粒子의 表面으로 부터反應을 일으켜 灰色의 窒化硅素로 變하고 있음을 볼 수 있는데 維持時間이 오래될수록 硅素粒子의 크기는 차츰 작아지고 있다. Fig. 2B'(b)의 窒化加熱法으로 만든 試片 (A), (B) 및 (C)에 대한 顯微鏡사진을 Fig. 9에 나타내었다. 순수한 硅素로 만든 試片 (A)와 MgO를 添加하여 만든 試片은 未反應의 硅素粒子가 크고 부분적으로 큰 氣孔을 보이고 있다. 이 氣孔은 Moulson等이 제안한 氣孔移動說^{1,8)}로서는 說明하기 어려울만큼 상당히 큰 것으로 내부의 큰 MgO粒子와 化合하여 생긴 低熔 melt가 蒸發되어 생긴 것으로 짐작된다. 그러나 Mg(NO₃)₂·6H₂O를 添加하여 热分解시킨 단돈 試片 (C)에서는 硅素粒子와 氣孔의 크기가 작은 良好한組織을 보이고 있다. Fig. 2B'(b)의 方法으로 窒化反應시킨 試片(A), (B) 및 (C)를 다시 1,390°C와 10.5 kgf/cm²의 窒素壓下에서 3時間 處理한 Fig. 2B'(c)의 試片들에 대한 顯微鏡사진을 Fig. 10에 나타내었다. Fig. 9와 Fig. 10에서 對應되는 試片들의 微構造는 서로 비슷하나 Fig. 10의 硅素粒子 表面은 凹凸이 심한 편이다. 또 未反應의 硅素粒子는 약간 작고生成된 窒化硅素로 완전히 둘러싸여 있다. 이러한 사실들로 부터 Mg(NO₃)₂·6H₂O는 硅素의 窒化反應에促進效果를 줄 뿐 아니라 級密한 組織을 얻는데 도움을 주는 것으로 생각된다. 成形體(B)를 Fig. 2C'(f)와 (g)의 窒化反應方法으로 만든 試片들에 대한 顯微鏡사진을 Fig. 11 및 12에 나타내었다. 低溫에서 長時間維持한 (f)에서는 未反應의 硅素粒子가 약간 보이고 있



Fig. 11 Photograph of specimen (B), nitrided on the heating profile of Fig. 2C''(f).

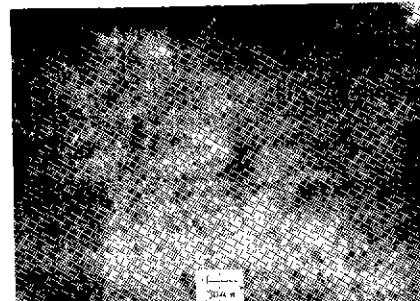


Fig. 12 Photograph of specimen (B), nitrided on the heating profile of Fig. 2C'(g).

으나 高溫에서 長時間維持한 (g)에서는 未反應의 硅素粒子가 거의 보이지 않은데 이것은 窒化反應의 溫度 및 維持時間의 條件이 良好한結果를 나타내는 것으로 생각된다.

IV 結 論

窒化硅素體를 densification시키는 한 方法으로 粗粒子의 硅素粒子調節을 하여 高壓(4.224 kgf/cm²)의 isostatic 成形으로 級密質 compact를 만들어서 窒化

反應을 지키고자 하였다. 그러나 細密質 compact의 窒化反應은 內部의 硅素와 窒素가스가 深度에 잘 안되어 窒化反應이 完結되기가 어렵다. 따라서 硅素表面에 窒化助劑를 coating하고 窒化反應加熱法을 調節하므로써 窒化反應을 完結하고자 하였다. 얻어진 結果는 다음과 같다.

- 粗粒, 粒度調節, 高壓成形等으로 充填性이 좋은 硅素 compact의 窒化反應은 1,350°C에서 長時間(240時間) 維持하더라도 窒化率 92% 이상을 얻기는 어려웠다.

- 低温(1,150°C)에서 長時間維持하는 것은 窒化率에 큰 도움을 주지 못하였다.

- 低温에서는 α -相의 生成, 高溫에서는 β -相의 生成이 높았다.

- 1,390°C에서 高壓(10.5 kgf/cm²)의 窒素胚은 窒化率에는 큰 도움을 주지 못했으나 $\alpha \rightarrow \beta$ 轉移에는 促進效果를 주었다.

- 窒化率과 微構造에 가장 좋은 窒化加熱條件은 1,150°C로 부터 段階의 溫度를 上昇시켜서(65時間) 高溫(1,390°C)에서 50時間 維持하는 것이었다(Fig. 2C'(g)).

- Mg(NO₃)₂·6H₂O는 MgO 보다 窒化率이 높았는데 이것은 热分解하여 硅素表面에 均一한 分布의 MgO film을 이루고 또 表面 SiO 層과의 forsterite 生成⁵⁾이 쉽기 때문에 생각된다. 또 이것은 細密한 微構造를 만드는데 더 效果的이었다.

後記: 이 研究에 도움을 주신 영국 Leeds 대학의 Dr. A. J. Moulson과 Dr. J. R. G. Evans께 깊은 감사를 드린다.

References

- A. J. Moulson, "Reaction-bonded silicon nitride, its formation and properties", *J. Mater. Sci.*, **14** 1017-1051 (1979).
- J. F. Collins, R. W. Gerby, "New refractory uses for silicon nitride reported", *J. Metals*, May, 612-615 (1955).
- R. D. Pehlke, J. F. Elliott, "High-temperature thermodynamics of the silicon, nitrogen, silicon nitride system", *Trans. Met. Soc., AIME* 215, Oct., 781-785 (1959).
- 朴企詰, 崔相旭, "窒化反應用 金屬珪素 및 그 compacts의 characterization", *요한학회지*, 20(3) 211-216 (1983).
- Idem, "珪素의 窒化反應에 있어 酸化마그네시움의 效果", *ibid.*, **20** (4) 305-314 (1983).
- A. Atkinson, A. J. Moulson, "Some important variables affecting the course of the reaction between silicon powder and nitrogen", *Science of Ceramics Vol. 8* edited by Gerald H. Stewart, p. 117-121, Brit. Ceram. Soc., Acad. Press, Stoke-on-Trent, (1976).
- S. M. Boyer, D. Sang, A. J. Moulson, "The effects of iron on the nitridation of silicon", *Nitrogen Ceramics*, edited by F. L. Riley, p.297-312, Noordhoff, Leyden, (1977).
- S. M. Boyer, A. J. Moulson, "A mechanism for the nitridation of Fe-contaminated silicon", *J. Mater. Sci.*, **13** (8) 1637-1646 (1978).
- P. Arundale, A. J. Moulson, "Microstructural changes during the argon-sintering of silicon powder", *J. Mater. Sci.*, **12** (10) 2138-2140 (1977).
- W. Kaiser, C. D. Thurmond, "Nitrogen in silicon", *J. App. Phys.*, **30** (3) 427-431 (1959).
- M. Mitomo, "Effect of Fe and Al additions on nitridation of silicon", *J. Mater. Sci.*, **12** 273-276 (1977).
- B. F. Jones, M. W. Lindley, "The influence of hydrogen on the nitriding gas on the strength of reaction-sintered silicon nitride", *J. Mater. Sci.*, **11** (10) 1969-1971 (1976).
- H. Dervisbegovic, F. L. Riley, "The influence of iron and hydrogen in the nitridation of silicon", *J. Mater. Sci.*, **14** (5) 1265-1268 (1979).
- D. Campos-Loriz, S. P. Howlett, F. L. Riley, F. Yusaf, "Fluoride accelerated nitridation of silicon", *J. Mater. Sci.*, **14**, 2325-2334 (1979).
- P. Popper, S. N. Ruddlesden, "Preparation, properties and structure of silicon nitride", *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **60**, 603-626 (1961).
- Daniel B. Leiser, O. J. Whittmore, Jr., "Compaction behavior of ceramic particles", *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **49** (8) 714-717 (1970).
- T. P. Herbell, T. K. Glasgow, N. J. Shaw, "Reaction-bonded silicon nitride prepared from wet attrition milled silicon", NASA TM-81428, Lewis Research Center, Cleveland, Ohio, (1980).

- 18) T. P. Herbell, T. K. Glasgow, "Bend strengths of reaction-bonded silicon nitride prepared from dry attrition milled silicon powder", NASA TM-79230, Lewis Research Center, (1979).
- 19) N. L. Parr, E. R. W. May, "The technology and engineering application of reaction bonded Si_3N_4 ", *Proc. Brit. Ceram. Soc.*, **1** (7) 81-93 (1967).
- 20) Nancy J. Shaw, "Nitridation of silicon", NASA TM-82722, Lewis Research Center, Ohio (1981).
- 21) John A. Mangels, "Effects of $\text{H}_2\text{-N}_2$ nitriding atmospheres on the properties of reaction-sintered Si_3N_4 ", *J. Am. Ceram. Soc.*, **58** (7-8) 354-355 (1975).
- 22) N. J. Shaw, "The combined effects of Fe and H_2 on the nitridation of silicon", *J. Mater. Sci.*, **1**, 337-340 (1982).
- 23) D. P. Elias, B. F. Jones, M. W. Lindley, "The formation of the α -, β -phase in reaction sintered silicon nitride and their influence on strength", *Powder Metall. Int.*, **8**, (4) 162-165 (1976).
- 24) W. M. Dawson, A. J. Moulson, "The combined effect of Fe and H_2 on the kinetics of silicon nitridation", *J. Mater. Sci.*, **13** (10) 2289-2290 (1978).
- 25) M. N. Rahaman, A. J. Moulson, "The removal of surface silica and its effect upon silicon nitridation kinetics", *ibid.*, **16**, 2319-2321 (1981).
- 26) 松尾康史, 多島容, "Si₁₄N₃の焼結法の最近の進歩", *Ceramics Japan*, **18** (1) 10-15 (1983).
- 27) M. Mitomo, "Effect of oxygen partial pressure on nitridation of silicon", *J. Am. Ceram. Soc.*, (11-12) 527 (1975).
- 28) 池薙義, 韓基成, 崔相旭, "低温焼成ナスケル ladle 막돌의 특성에 관한 연구", *요업학회지*, **12** (2) 33-39 (1975).
- 29) M. W. Lindley, D. P. Elias, B. F. Jones, K. C. Pitman, "The influence of hydrogen in the nitriding gas on the strength, structure and composition of reaction-sintered silicon nitride", *J. Mater. Sci.*, **14** (1) 70-85 (1979).
- 30) H. Desvisbegovic, F. L. Riley, "The role of hydrogen in the nitridation of silicon powder compacts", *ibid.*, **16**, 1945-1955 (1981).
- 31) A. Atkinson, A. J. Moulson, E. W. Roberts, "Nitridation of high-purity silicon", *J. Mater. Sci.*, **10**, 1242-1243 (1975).
- 32) B. F. Jones, M. W. Lindley, "Reaction sintered silicon nitride", *ibid.*, **11**, 1288-1295 (1976).
- 33) H. M. Jenning, "Review on reactions between silicon and nitrogen", *ibid.*, **18**, 951-967 (1983).
- 34) John A. Mangels, "Effect of rate controlled nitriding and nitriding atmospheres on the formation of reaction bonded Si_3N_4 ", *Am. Cer. Soc. Bull.*, **60** (6) 613-617 (1981).
- 35) 이근예, "反応結合窒化珪素의 物性에 미치는 初期 窒素分壓의 영향", 仁荷大 碩士論文, 8月, (1983).
- 36) G. R. Terwilliger, "Properties of sintered Si_3N_4 ", *J. Am. Ceram. Soc.*, **57** (1) 48-50 (1974).
- 37) Philip Wong, Donald R. Messier, "Procedure for fabrication of Si_3N_4 by rate-controlled reaction sintering", *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **57** (5) 525-526 (1978).
- 38) T. P. Herbell, T. K. Glasgow, H. C. Yeh, "Effect of attrition milling on the reaction-sintering of silicon nitride", NASA TM-78965 DOE/NASA/1040-73/2 (1978).
- 39) J. R. G. Evans, A. J. Moulson, "On the use of powder beds in the nitridation and subsequent densification of REBN", *J. Mater. Sci. Lett.*, **2**, 236-238 (1983).
- 40) C. F. Gazzara, D. R. Messier, "Quantitative determination of phase content of silicon nitride by X-ray diffraction analysis", AMMRC TR-75-4 Army Materials and Mechanics Research Center, Watertown, Massachusetts, Feb. (1975).
- 41) A. Atkinson, P. T. Leat, A. J. Moulson, E. W. Roberts, "A mechanism for the nitridation of silicon powder compacts", *J. Mater. Sci.*, **9** 981-984 (1974).
- 42) H. M. Jennings, M. H. Richman, "Structure, formation mechanism and kinetics of reaction-bonded silicon nitride", *ibid.*, **11** 2087-2098 (1976).